C 波段 3. 5W/mm, PAE > 40 %的 In Ga P/ Ga As HBT 功率管 *

申华军 陈延湖 严北平 葛 霁 王显泰 刘新宇 吴德馨

(中国科学院微电子研究所,北京 100029)

摘要:通过优化 In CaP/ CaAs 异质结双极晶体管(HBT)的材料结构和器件结构,采用 BE 金属自对准、发射极镇流和电镀空气桥等工艺技术,研制了 C 波段 In CaP/ CaAs HBT 功率管.其击穿电压 BV_{CBO} 大于 31V , BV_{CEO} 大于 21V ;在 5.4 GHz 时连续波(CW)饱和输出功率达到 1.4 W,功率密度达到 3.5 W/mm,功率附加效率(PAE)大于 40 %.

关键词: In GaP/ GaAs; 异质结双极晶体管; 功率管

EEACC: 2560J; 2560P

中图分类号: TN325⁺.3 文献标识码: A 文章编号: 0253-4177(2006)09-1612-04

1 引言

HBT具有功率密度高,线性度好,易于实现功率匹配和宽带匹配等优点,并可以单电源供电工作,电路设计更简化、灵活. In GaP/ GaAs HBT 功率器件和电路广泛应用于无线通信设备(如手机、蓝牙通信、WLAN、卫星转发器等)的功放电路中[1~3]. In-GaP/ GaAs HBT与A1GaAs/ GaAs HBT相比,具有偏移电压更小,电流增益随温度变化更加稳定的优点;且不含有A1及相关缺陷,器件稳定性更好,可靠性更高;In GaP与 GaAs之间更容易实现选择性腐蚀,工艺重复性好,成品率高.

目前国内对 In Ga P/ Ga As HB T 的研究较少, 主要集中在高速和小功率应用^[4,5]. 本文通过优化 材料结构参数和器件结构参数,采用国产 HB T 外延材料研制出高击穿 In Ga P/ Ga As HB T 功率管, 发射极面积为 10 ×(40µm ×2.5µm)的功率管在 9V 偏置电压 AB 类工作状态下,5.4 GHz 时连续波输出功率达到 1.4W,功率密度达到 3.5W/mm,是目前国内最好的报道结果,对于开展 HB T 功率器件的实用化研究和单片电路研究具有重要意义.

2 器件材料和结构设计

2.1 器件外延材料结构参数设计

GaAs HBT 功率器件外延材料结构设计的关键是集电区外延层的优化设计,以满足高电压、大电

*中国科学院创新基金资助项目(批准号: KGCX2-SW-107)

†通信作者. Email:tohuajun @hotmail.com

流工作的要求. 为了获得较高的击穿电压,集电结耗尽层的宽度 X_{dep} 要足够宽,因而需要增加集电区外延层厚度 X_C ,并降低集电区掺杂浓度 N_C . 另一方面,HBT 集电区的空间电荷渡越时间与空间电荷区厚度成正比,过厚的集电区将导致 f_T 的下降. 根据 Kirk 电流密度的关系式

I Kirk qNc Vsat

可知,为了使 HBT 功率管具有较大的工作电流,集电区掺杂浓度 N_c 不能太低. 因此,功率 HBT 的集电区材料结构设计需要依据以上讨论折中优化,经过不同材料结构的实验比较,选择集电区厚度为 1000nm,掺杂浓度为 $1 \times 10^{16} cm^{-3}$.

表 1 所示为 HBT 外延材料结构的优化设计结果. 基区采用 Be 掺杂 4 $\times 10^{19}$ cm⁻³ 的高掺杂外延层,

表 1 In GaP/ GaAs HBT 的器件材料结构 Table 1 Material structure of In GaP/ GaAs HBT

Layer	x	Thickness / nm	Doping concentration / cm ⁻³
n^+ -In _x Ga _{1-x} As	0.6	50	>1 ×10 ¹⁹
n^+ -In $_x$ Ga _{1-x} As	0.6~0	50	>1 ×10 ¹⁹
n + - GaAs		250	5 ×10 ¹⁸
$n^ In_x Ga_{1-x} P$	0.5	50	3 × 10 ¹⁷
GaAs		5	undoped
p + + - GaAs		80	>4 ×10 ¹⁹
GaAs		5	undoped
n GaAs		1000	1 ×10 ¹⁶
n + - GaAs		500	5 ×10 ¹⁸
		•	

SI GaAs

以降低基区电阻,提高器件频率特性,在基区层上下分别加入 5nm 未掺杂 GaAs 层,以阻止基区掺杂 Be 的扩散;发射极帽层采用 5 ×10¹⁸ cm⁻³的 GaAs 外延层过渡到 In GaAs 外延层,亚集电区采用 5 ×10¹⁸ cm⁻³的 GaAs 外延层,以降低发射极和集电极串联电阻,提高效率.

2.2 器件几何结构参数设计

HBT 器件的结构参数设计包括:发射极的长度和宽度的选择,多指 HBT 排列的拓扑结构以及镇流措施等. 高频工作时,为了降低发射极电流集边效应的影响,并考虑发射极接触孔刻蚀工艺和高频分布效应,选择发射极宽度 W_E 为 2. $5\mu_m$,发射极长度 L_E 为 $40\mu_m$.

由于 GaAs 衬底的热导率差和各 HBT 之间的热耦合作用,导致 HBT 功率管发生电流增益塌陷现象,如图 1 所示.抑制电流增益塌陷的措施有降低器件热阻、引入镇流电阻等,镇流电阻是最直接有效的方法.本文采用优化设计的发射极镇流电阻 RE 采抑制电流增益塌陷,每一个发射极上的 RE 分担了加在 BE 结上的电压降,起到了负反馈的作用,单指 HBT 所需的最小镇流电阻 Report 的公式为[6]

$$\begin{array}{rcl} R_{\,\mathrm{F}\,\mathrm{opt}} & = & R_{\,\mathrm{th}} & B\,V_{\,\mathrm{CEO}} & - \\ \\ & & 2\,(\frac{-\,k\,T_{\mathrm{A}}}{q} & \textbf{x}\,\frac{R_{\,\mathrm{th}} - B\,V_{\,\mathrm{CEO}}}{I_{\,\mathrm{Kirk}}})^{\,1/2} \end{array}$$

式中 R_{th} 为器件的热阻; 为热电反馈系数; T_A 为环境温度; 为电流理想因子; I_{Kirk} 为 Kirk 电流. 衬底厚度为 100μ m 的 GaAs HBT 晶体管中, = 1.2 mV/ , $R_{th} = 650$ / W, = 1.6 m 假定 $I_{Kirk} = 20 \text{mA}$, $BV_{CEO} = 20 \text{V}$, $T_A = 300 \text{ K}$,则计算每个 HBT 所需的最小发射极镇流电阻为 7 . 为了有效地镇流,设计每个 HBT 的 R_E 为 10 . 采用十指 HBT 并排连接的拓扑结构 ,相邻 HBT 晶体管之间相隔约 40μ m ,以降低热互耦.

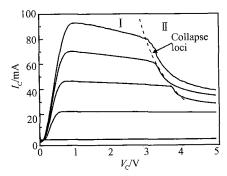


图 1 多指未镇流 In GaP/ GaAs HBT 器件的 FV 特性 Fig. 1 FV characteristics of multi-fingers In GaP/ GaAs HBT without ballasting resistor

3 器件制备及性能测试

3.1 功率管制作

在中国科学院微电子研究所的 100mm 化合物 工艺线上完成了 HBT 功率管的流片,器件的主要 工艺流程包括:蒸发发射极金属,以发射极金属为掩 蔽腐蚀盖帽层,钝化 Ledge 制作,蒸发自对准基极 金属,腐蚀集电极台面和器件隔离台面,蒸发集电极 金属并合金,Si₃N₄ 介质钝化保护,溅射 NiCr 电阻, 金属布线互连,电镀空气桥,背面减薄和背孔刻蚀, 背面金属化等.BE金属自对准工艺可以最小化发射 极和基极之间的距离,降低外基区电阻,有助于提高 器件的高频性能:外基区耗尽的 In GaP 层形成钝化 Ledge 结构[7],有助于提高器件的增益和可靠性.集 电极采用电镀空气桥互连,减薄衬底至 100µm, Pad 背面通孔并背面金属化,有效地降低功率管的热阻, 提高器件的高频功率性能和热稳定性. 针对 HBT 功率管高台面差等特点,进行了 HBT 功率器件工 艺研究,优化了工艺流程,以上措施使 HBT 功率管 成品率大于90%.

图 2 为制得的 In Ga P/ Ga As HB T 功率管单胞的显微镜照片,发射极面积为 $10 \times (40 \mu m \times 2.5 \mu m)$.图 3 为 HB T 功率管的击穿电压特性, BV_{CBO} 大于 31V, BV_{CEO} 大于 21V,满足 9V 工作电压的需求,可见集电区外延层参数设计合理.



图 2 In GaP/ GaAs HBT 功率管照片 Fig. 2 Picture of the In GaP/ GaAs HBT power transistor

图 4 为所研制功率管的 FV 特性 ,可见 R_E 有效镇流 ,在 10V 集电极电压时没有出现电流增益塌陷现象 ,功率管的热稳定性良好 .图 5 为直流增益随集电极电流密度的变化曲线 ,最大电流增益大于 170 ,对应集电极电流密度为 $33kA/cm^2$,最大工作电流可达 330mA .

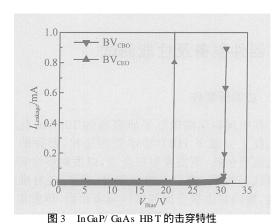


Fig. 3 Measured B-C and E-C junction breakdown voltage of the In GaP/ GaAs HBT

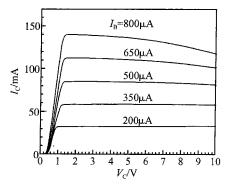


图 4 器件尺寸为 10 ×(40µm ×2.5µm) In Ga P/ Ga As HB T 的 I-V 特性

Fig. 4 I-V characteristics of InGaP/ GaAs HBT with $10 \times (40 \mu m \times 2.5 \mu m)$ emitters

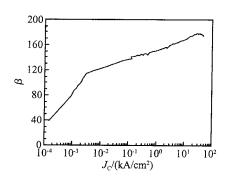


图 5 In GaP/ GaAs HBT 的直流增益 Fig. 5 Current gain of In GaP/ GaAs HBT

3.2 功率管高频和功率测试结果

使用 HP8510 网络分析仪片测试 HBT 器件单胞的小信号 S 参数 ,结果如图 6 所示. HBT 功率管的截止频率 f_T 为 28 GHz ,最大振荡频率 f_{max} 为 31 GHz ,在 5.4 GHz 时最大稳定功率增益 MSG 为 13 dB ,高频性能良好.

将 HBT 功率管进行管壳封装后,在自行搭建

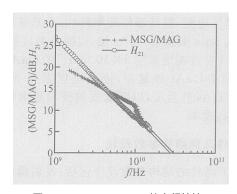


图 6 In GaP/ GaAs HBT 的高频特性 Fig. 6 Measured small-signal performance of 10 ×

(40µm x2. 5µm) In GaP/ GaAs HBT

的功率匹配测试平台上测试功率管的大信号功率特性. 集电极偏置电压为 9V,偏置电流为 $110 \, \text{mA}$, AB 类工作状态 ,5. $4 \, \text{GHz}$ 时连续波测试结果如图 $7 \, \text{所}$ 元. 其线性功率增益为 $7. \, 4 \, \text{dB}$,1 dB 增益压缩点输出功率 $P_{-1 \, \text{dB}}$ 为 $29 \, \text{dBm}$, 饱和输出功率 P_{sat} 达到 $31. \, 6 \, \text{dBm}$ (1. $45 \, \text{W}$) ,功率密度达到 $3. \, 5 \, \text{W/mm}$,PAE 大于 $40 \, \%$,高频功率性能优异.

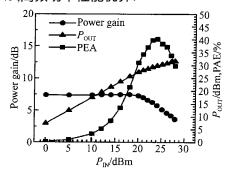


图 7 In Ga P/ Ga As HBT 的功率特性 Fig. 7 Measured large signal performance of 10 × (40µm ×2.5µm) In Ga P/ Ga As HB T

4 结论

使用国产 HBT 材料,通过合理地设计外延层材料结构参数和器件结构参数,采用 BE 金属自对准、发射极镇流电阻、电镀空气桥、衬底减薄、背面金属化等工艺技术制备了 C 波段 In GaP/ GaAs 高频功率管.其直流和高频性能良好.在 5.4 GHz 测试频率下,发射极面积为 10 ×(40µm ×2.5µm)的功率管单胞饱和输出功率大于 1.4W,功率密度达到 3.5 W/mm,PAE 大于 40%,高频功率性能优异. HBT 功率管成品率大于 90%,为单片功放电路的研制奠定了良好的基础.

致谢 感谢中国科学院上海微系统与信息技术研究 所的齐鸣教授和徐安怀博士在 HBT 外延材料生长 和提供上给予的大力支持;感谢中国电子科技集团公司第五十五所一中心提供的背面工艺帮助.

参考文献

- [1] Ali F, Gupta A, Higgins A. Advances in GaAs HBT power amplifiers for cellular phones and military applications. Digest of Microwave and Millimeter Wave Monolithic Circuits Symposium, 1996:61
- [2] Wadsworth S D, Davies R A, Davies I, et al. GaInP/ GaAs HBTs: state of the art and future trends. International Symposium on Signals, Systems, and Electronics, 1998:40
- [3] Blanck H, Riepe KJ, Doser W, et al. Industrial GaInP/ GaAs Power HBT MMIC Process. Proceedings of the Gallium Arsenide Applications Symposium, Paris, 2000:113
- [4] Liu Honggang, Yuan Zhipeng, He Zhijing, et al. Super per-

- formance In GaP/ GaAs heterojunction bipolar transistor with hexagonal emitter. Chinese Journal of Semiconductors, 2003, 24(11):1135
- [5] Qian Yongxue, Liu Xunchun, Wang Runmei, et al. Selfaligned GaInP/GaAs HBT device. Chinese Journal of Semiconductors,2002,23(5):513(in Chinese)[钱永学,刘训春,王 润梅,等. 自对准 GaInP/GaAs HBT 器件. 半导体学报, 2002,23(5):513]
- [6] Liu W. Handbook of heterojunction bipolar transistors. John Wiley & Sons, Inc., 1998
- [7] Zheng Liping, Liu Xinyu, Yuan Zhipeng, et al. Passivation ledge fabrication and its effect on performance of self-aligned In GaP/ GaAs HBT with variety of emitter sizes. Chinese Journal of Semiconductors, 2004, 25(3):312(in Chinese)[郑丽萍,刘新宇,袁志鹏,等. 钝化边的制作及其对不同尺寸自对准In GaP/ GaAs HBT性能的影响. 半导体学报, 2004, 25(3):312]

C-Band 3. 5W/ mm In Ga P/ Ga As HBT Power Transistors with > 40 % Power-Added Efficiency *

Shen Huajun[†], Chen Yanhu, Yan Beiping, Ge Ji, Wang Xiantai, Liu Xinyu, and Wu Dexin

(Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China)

Abstract: A C-band In GaP/ GaAs HBT power transistor with an optimized material structure and device peripheral structure is designed and fabricated by base-emitter metal self-aligning, emitter ballasting, and an electric plated air bridge. The measured BV $_{\text{CBO}}$ is greater than 31V and the BV $_{\text{CEO}}$ is greater than 21V. At a frequency of 5. 4GHz, the saturated CW output power of the fabricated HBT power transistor is more than 1. 4W with a maximum power density of 3. 5W/mm, and the power added efficiency is greater than 40%.

Key words: In GaP/ GaAs; power; heterojunction bipolar transistor

EEACC: 2560J; 2560P

Article ID: 0253-4177 (2006) 09-1612-04

^{*} Project supported by the Innovation Foundation of the Chinese Academy of Sciences (No. KGCX2-SW-107)

[†]Corresponding author. Email:tohuajun@hotmail.com